

地盤工学会:実務シリーズ3.「シールド工法の調査・設計から施工まで」改良案

頁・位置	誤	正
p57 表-4.8(a),(b) <sup>1)</sup>	k(kN/mm <sup>3</sup> )	k(MN/m <sup>3</sup> )
p101 下から5行目 <sup>2)</sup>		Rankineの式 $K_a = \tan^2(45^\circ - \phi/2) \cdots (5.3)$ ここに, $K_a$ :主働土圧係数
p102 図-5.3 縦断方向緩み長さ <sup>3)</sup>		B
p125 19行目 p126 写真-5.2 <sup>1)</sup>		後方台車
p232 表-7.3		シリコーン SiO <sub>2</sub> についてゴムはシリコーン、 半導体はシリコンと呼ぶ。

参考文献

1)土木学会:トンネル標準示方書[シールド工法編]、1996.

に抛り 1kgf=10N SI換算例 5kgf/cm<sup>3</sup>=50MN/m<sup>3</sup>

2)山口:土質力学、技報堂、1975年6月改訂

3)田中他:シールド工法と土質 3.切羽などの安定と土質(その3)村山教授の安定解析法、土質工学会、1981.11